

ICS 29.045

H 80/84



团 体 标 准

T/IAWBS 015-2021

氧化镓单晶片 X 射线双晶摇摆曲线半高宽测试方法

Test method for full width at half maximum of double crystal X-ray rocking curve of Ga₂O₃ single crystal substrate

2021-09-15 发布

2021-09-22 实施

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟 发布

目 录

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 检测原理.....	1
4.1 晶体 X 射线衍射原理.....	1
4.2 摇摆曲线测试原理.....	2
4.3 晶体摇摆曲线半高宽.....	2
5 仪器及校准.....	2
5.1 光路配置.....	2
5.2 样品台.....	2
5.3 仪器校准.....	3
6 测试样品.....	3
7 干扰因素.....	3
8 测试环境.....	3
9 测试步骤.....	3
10 精密度.....	4
11 测试报告.....	4
附 录 A.....	5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，并根据该文件进行样式修改。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟归口。

本文件起草单位：中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟，北京邮电大学，北京镓族科技有限公司

本文件主要起草人：李培刚、郭道友、吴忠亮、陈旭、唐为华。

本文件为首次制定。

